

2026年度ナノプロセッシング施設(NPF)単価表

2026年4月1日改訂(暫定版)

装置番号	装置名称	設置場所	装置分類	トレーニング カテゴリ	備考(注1)	利用報告書提出&データ提供			利用報告書提出			利用報告書非提出(注4)&データ提供			利用報告書非提出(注4)		
						機器利用	技術補助	技術代行 (注3)	機器利用	技術補助	技術代行 (注3)	機器利用	技術補助	技術代行 (注3)	機器利用	技術補助	技術代行 (注3)
						(円/時間)	(円/時間)	(円/時間)	(円/時間)	(円/時間)	(円/時間)	(円/時間)	(円/時間)	(円/時間)	(円/時間)	(円/時間)	(円/時間)
NPF003	イオンコーター(FIB付帯)(2F)	2F 一般実験室	観察・計測・分析	0		500	9500	11500	500	9500	11500	4000	22000	26000	5000	22000	26000
NPF004	電界放出形走査電子顕微鏡[S4800 FE-SEM]	CR1 クリーンルーム	観察・計測・分析	3	有償トレーニング	8000	20000	22000	11200	28000	30800	16000	40000	44000	22400	56000	61600
NPF006	マスクレス露光装置	CR2 イエロールーム	リソグラフィ	2	有償トレーニング	10400	20400	23400	14500	28500	32700	29000	49000	55000	40600	68600	77000
NPF008	スピノーター(フォト)	CR2 イエロールーム	リソグラフィ	0		500	9500	11500	500	9500	11500	4000	22000	26000	5000	22000	26000
NPF009	コンタクトマスクライナー[MJB4]	CR2 イエロールーム	リソグラフィ	2	有償トレーニング	2600	12600	15600	3600	17600	21800	6400	26400	32400	8900	36900	45300
NPF010	反転露光用全UV照射装置	CR1 クリーンルーム	リソグラフィ	1	有償トレーニング	500	9500	11500	500	9500	11500	4000	22000	26000	5000	22000	26000
NPF011	露光装置	CR3 イエロールーム	リソグラフィ	3	技術代行専用	19500	31500	33500	27300	44100	46900	52000	76000	80000	72800	106400	112000
NPF012	有機ドラフトチャンバー 右(フォト)(注5)	CR2 イエロールーム	リソグラフィ	0		500	9500	11500	500	9500	11500	4000	22000	26000	5000	22000	26000
NPF013	有機ドラフトチャンバー 左(フォト)(注5)	CR2 イエロールーム	リソグラフィ	0		500	9500	11500	500	9500	11500	4000	22000	26000	5000	22000	26000
NPF014	有機ドラフトチャンバー 右(EB)(注6)	CR1 クリーンルーム	リソグラフィ	0		500	9500	11500	500	9500	11500	4000	22000	26000	5000	22000	26000
NPF015	酸アルカリドラフトチャンバー 右	CR1 クリーンルーム	表面処理	0		500	12500	14500	500	12500	14500	6200	30200	34200	7700	30200	34200
NPF016	スターラーウオーターパス[SWB-10L-1]	CR1 クリーンルーム	表面処理	0		500	9500	11500	500	9500	11500	4000	22000	26000	5000	22000	26000
NPF017	スマートウオーターパス[TB-1N](フォト)	CR2 イエロールーム	リソグラフィ	0		500	9500	11500	500	9500	11500	4000	22000	26000	5000	22000	26000
NPF018	反応性イオンエッチング装置(RIE)	CR5 クリーンルーム	エッチング	2	有償トレーニング	4000	14000	17000	5600	19600	23800	10400	30400	36400	14500	42500	50900
NPF019	多目的エッチング装置(ICP-RIE)	CR5 クリーンルーム	エッチング	2	有償トレーニング	10400	20400	23400	14500	28500	32700	29000	49000	55000	40600	68600	77000
NPF021	プラズマアッシャー	CR5 クリーンルーム	表面処理	0		500	9500	11500	500	9500	11500	4000	22000	26000	5000	22000	26000
NPF022	UVオゾンクリーナー	CR5 クリーンルーム	表面処理	0		500	9500	11500	500	9500	11500	4000	22000	26000	5000	22000	26000
NPF023	電子ビーム真空蒸着装置	CR1 クリーンルーム	成膜	2	有償トレーニング	9000	19000	22000	12600	26600	30800	19000	39000	45000	26600	54600	63000
NPF024	抵抗加熱型真空蒸着装置	CR1 クリーンルーム	成膜	2	有償トレーニング	5000	15000	18000	7000	21000	25200	10000	30000	36000	14000	42000	50400
NPF025	スパッタ成膜装置(芝浦)	CR1 クリーンルーム	成膜	2	有償トレーニング	6000	16000	19000	8400	22400	26600	12000	32000	38000	16800	44800	53200
NPF029	メッキ装置	CR1 クリーンルーム	成膜	3	有償トレーニング	2600	14600	16600	3600	20400	23200	8000	32000	36000	11200	44800	50400
NPF030	プラズマCVD薄膜堆積装置	CR5 クリーンルーム	成膜	2	有償トレーニング	4600	14600	17600	6400	20400	24600	16000	36000	42000	22400	50400	58800
NPF031	原子層堆積装置 1[FlexAL]	CR5 クリーンルーム	成膜	2	技術代行専用	8000	18000	21000	11200	25200	29400	19200	39200	45200	26800	54800	63200
NPF032	クロスセクションポリッシャー(ALD付帯)	CR1 クリーンルーム	観察・計測・分析	2	有償トレーニング	4000	14000	17000	5600	19600	23800	9600	29600	35600	13400	41400	49800
NPF033	アルゴニング装置	CR1 クリーンルーム	エッチング	2	有償トレーニング	4000	14000	17000	5600	19600	23800	9600	29600	35600	13400	41400	49800
NPF034	集束イオンビーム加工観察装置(FIB)	2F 一般実験室	観察・計測・分析	3	技術代行専用	13000	25000	27000	18200	35000	37800	29000	53000	57000	40600	74200	79800
NPF035	イオンコーター(SEM付帯)(2F)	2F 一般実験室	観察・計測・分析	0		500	9500	11500	500	9500	11500	4000	22000	26000	5000	22000	26000
NPF038	二次イオン質量分析装置(D-SIMS)	2F 一般実験室	観察・計測・分析	2	技術代行専用	9100	19100	22100	12700	24600	28100	25000	45000	51000	35000	59500	65100
NPF039	オゾンクリーナー(SIMS付属)	2F 一般実験室	観察・計測・分析	0		500	9500	11500	500	9500	11500	4000	22000	26000	5000	22000	26000
NPF041	ウェハ加熱炉	CR1 クリーンルーム	熱処理	1	有償トレーニング	2000	11000	13000	2800	15400	18200	6400	24400	28400	8900	34100	39700
NPF042	クリーンオープン	CR1 クリーンルーム	熱処理	0		500	9500	11500	700	13300	16100	4000	22000	26000	5600	30800	36400
NPF044	マップル炉	CR1 クリーンルーム	熱処理	0		500	9500	11500	500	9500	11500	4000	22000	26000	5000	22000	26000
NPF045	触針式段差計	CR1 クリーンルーム	観察・計測・分析	0		500	9500	11500	500	9500	11500	4000	22000	26000	5000	22000	26000
NPF046	走査プローブ顕微鏡SPM_1[NanoscopeIV /Dimension3100](注8)	CR1 クリーンルーム	観察・計測・分析	3	有償トレーニング	4000	16000	18000	5600	22400	25200	10400	34400	38400	14500	48100	53700
NPF047	走査プローブ顕微鏡SPM_2[SPM-9600/9700](注8)	2F 一般実験室	観察・計測・分析	3	有償トレーニング	4000	16000	18000	5600	22400	25200	10400	34400	38400	14500	48100	53700
NPF048	ナノサータ顕微鏡SPM_3[SFT-3500](注8)	CR1 クリーンルーム	観察・計測・分析	3	有償トレーニング	5200	17200	19200	7200	24000	26800	13000	37000	41000	18200	51800	57400
NPF049	ナノプローバ[N-6000SS]	2F 一般実験室	観察・計測・分析	3	技術代行専用	10400	22400	24400	14500	31300	34100	22400	46400	50400	31300	64900	70500
NPF050	四探針プローブ抵抗測定装置	CR1 クリーンルーム	観察・計測・分析	0		500	9500	11500	700	13300	16100	4000	22000	26000	5600	30800	36400
NPF051	デバイスパラメータ評価装置	CR1 クリーンルーム	観察・計測・分析	2	有償トレーニング	2600	12600	15600	3600	17600	21800	6400	26400	32400	8900	36900	45300
NPF052	デバイス容量評価装置	CR1 クリーンルーム	観察・計測・分析	2	有償トレーニング	2600	12600	15600	3600	17600	21800	6400	26400	32400	8900	36900	45300
NPF053	ワイヤボンダー(2F)	2F 一般実験室	観察・計測・分析	2	有償トレーニング	2600	12600	15600	3600	17600	21800	6400	26400	32400	8900	36900	45300
NPF054	ダイシングソー	CR4 クリーンルーム	その他	3	有償トレーニング	4600	16600	18600	6400	23200	26000	13000	37000	41000	18200	51800	57400
NPF055	スクライバー	CR4 クリーンルーム	その他	0		500	9500	11500	500	9500	11500	4000	22000	26000	5000	22000	26000
NPF056	研磨機	CR1 クリーンルーム	その他	2	有償トレーニング	1300	11300	14300	1800	15800	20000	4000	24000	30000	5600	33600	42000
NPF060	短波長レーザー顕微鏡[VK-9700]	CR1 クリーンルーム	観察・計測・分析	1	有償トレーニング	2600	11600	13600	3600	16200	19000	7200	25200	29200	10000	35200	40800
NPF061	短波長レーザー顕微鏡[OLS-4100]	CR1 クリーンルーム	観察・計測・分析	1	有償トレーニング	2600	11600	13600	3600	16200	19000	9000	27000	31000	12600	37800	43400
NPF063	分光エリブメータ(注7)	CR1 クリーンルーム	観察・計測・分析	1	有償トレーニング	2600	11600	13600	3600	16200	19000	8000	26000	30000	11200	36400	42000
NPF064	解析用PC(分光エリブメータ用)(注7)	2F データ解析室	観察・計測・分析	0		500	12500	14500	500	12500	14500	4000	28000	32000	5000	28000	32000
NPF065	顕微レーザーラマン分光装置(RAMAN)(注8)	CR1 クリーンルーム	観察・計測・分析	2	有償トレーニング	4000	14000	17000	5600	19600	23800	9600	29600	35600	13400	41400	49800
NPF066	顕微フーリエ変換赤外分光装置(FT-IR)(注8)	CR1 クリーンルーム	観察・計測・分析	2	有償トレーニング	2600	12600	15600	3600	17600	21800	6400	26400	32400	8900	36900	45300
NPF067	解析用PC(SPM, FT-IR, Raman用)(注8)	2F データ解析室	観察・計測・分析	0		500	12500	14500	700	17500	20300	4000	28000	32000	5600	39200	44800
NPF068	磁気特性測定システム(MPMS)	2F 一般実験室	観察・計測・分析	2	有償トレーニング	3300	13300	16300	4600	18600	22800	7200	27200	33200	10000	38000	46400
NPF070	X線回折装置(XRD)	2F 一般実験室	観察・計測・分析	2	有償トレーニング	4000	14000	17000	5600	19600	23800	10400	30400	36400	14500	42500	50900
NPF072	微小部蛍光X線分析装置	CR1 クリーンルーム	観察・計測・分析	2	有償トレーニング	2600	12600	15600	3600	17600	21800	6400	26400	32400	8900	36900	45300
NPF073	解析用PC(X線用)	2F データ解析室	観察・計測・分析	0		500	12500	14500	500	12500	14500	4000	28000	32000	5000	28000	32000
NPF074	X線光電子分光分析装置(XPS)	2F 一般実験室	観察・計測・分析	2	有償トレーニング	5200	15200	18200	7200	21200	25400	9600	29600	35600	13400	41400	49800
NPF075	解析用PC(XPS用)	2F データ解析室	観察・計測・分析	0		500	12500	14500	500	12500	14500	4000	28000	32000	5000	28000	32000
NPF081	プラズマCVD薄膜堆積装置(SiN)	CR5 クリーンルーム	成膜	2	有償トレーニング	5200	15200	18200	7200	21200	25400	16000	36000	42000	22400	50400	58800
NPF082	化合物半導体エッチング装置(ICP-RIE)	CR5 クリーンルーム	エッチング	2	技術代行専用	11700	21700	24700	16300	30300	34500	29000	49000	55000	40600	68600	77000
NPF084	デジタルマイクロスコブ	CR1 クリーンルーム	観察・計測・分析	0		500	9500	11500	500	9500	11500	4000	22000	26000	5000	22000	26000
NPF085	物理特性測定装置(PPMS)	2F 一般実験室	観察・計測・分析	2	有償トレーニング	6500	16500	19500	9100	23100	27300	16000	36000	42000	22400	50400	58800
NPF086	マニュアルウェハローバ(2F)	2F 一般実験室	観察・計測・分析	2	有償トレーニング	2600	12600	15600	3600	17600	21800	6400	26400	32400	8900	36900	45300
NPF088	電界放出形走査電子顕微鏡[S4500 FE-SEM](2F)	2F 一般実験室	観察・計測・分析	3	有償トレーニング	4000	16000	18000	5600	22400	25200	13000	37000	41000	18200	51800	57400
NPF089	赤外線ランプ加熱炉(RTA)	CR1 クリーンルーム	熱処理	2	有償トレーニング	3300	13000	16300	4600	18600	22800	9000	29000	35000	12600	40600	49000
NPF091	自動塗布現像装置	CR2 イエロールーム	リソグラフィ	2	有償トレーニング	2600	12600	15600	3600	17600	21800	8000	28000	34000	11200	39200	47600
NPF092	高圧ジェットリフトオフ装置	CR2 イエロールーム	リソグラフィ	2	有償トレーニング	8000	18000	21000	11200	25200	29400	17600	37600	43600	24600	52600	61000
NPF093	高速電子ビーム描画装置(エリオニクス)	CR1 クリーンルーム	リソグラフィ	2	有償トレーニング	32500	42500	45500	45500	59500	63700	50000	70000	76000	70000	98000	106400
NPF094	解析用PC(CAD及び近接効果補正用)(注9)																

上記に該当しない場合は 1

詳細は、NPF事務局にお問い合わせ下さい。

電子メール: tia-npf-m@aist.go.jp

(注1)最初のご利用前には、トレーニング受講が必要です。「有償トレーニング」と記載された装置につきましては、有償となります。「技術代行専用」と記載された装置につきましては、原則技術代行のみでのご利用となります。

(注2)有償トレーニングの料金は、対象装置の有償トレーニングカテゴリーによって異なります。尚、額は、1回あたりのものとなります。ご自身の試料を用いたトレーニング、2回目以降のトレーニングを希望される場合は、技術補助を申請して下さい。

(注3)NPFのスタッフが他の施設(産総研の他の共用施設及びNIMS、筑波大学等他機関の共用施設)の装置の技術代行を行う場合は、当該施設の装置の機器利用料に加え一律12,000円(利用報告書提出)、24,000円(利用報告書不提出)を加算致します。

(注4)利用報告書非提出でご利用の場合は、ここに記載された金額の他に15%の「運営管理費」が加算されます。ご了承ください。

(注5)NPF012及びNPF013ドラフトチャンバはOR2内露光装置(NPF006、110、119、120)の塗布・現像場所も兼ねております。両装置のトレーニングは同時に行います。トレーニング申請の際は、NPF012を申請してください。

(注6)NPF014,NPF015,NPF111,NPF112のドラフトチャンバ4台のトレーニングは同時に行います。トレーニング申請の際は、NPF014を申請してください。

(注7)NPF064はNPF063のデータ解析用PCです。NPF063と同時にトレーニングします。

(注8)NPF067は、NPF046,047,048、065、066の共用のデータ解析用PCです。NPF046,047,048、065、066のいずれかをトレーニングを申請されると、同時にトレーニングします。

(注9)NPF094のCADツールは、L-Editとなります。